

时间平均法及应用

赵国清

(哈尔滨科学技术大学)

时间平均法为全息干涉计量术中常用的方法之一。

常用的全息干涉量度技术有三种,即两次曝光法、实时观察法和时间平均法。而时间平均法具有如下的特点:即使对粗糙的表面,也能出现清晰的干涉条纹;测量是非接触式的,同时可以测量光波波长数量级的微小振幅等优点。

本文的目的:结合我校激光研究室振型像片的研究,介绍时间平均法的近似分析及原理。

下面的两张照片就是我校激光研究室拍摄的压气机叶片、膜片的振型。

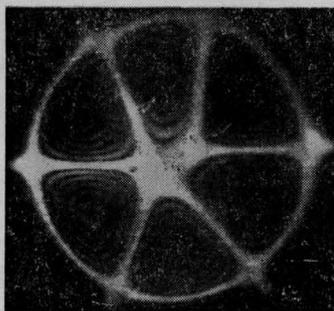


图 1

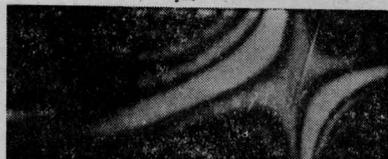


图 2

一、时间平均法的基本方程

为了考虑物体振动的问题,则物光 a 随

时间 t 的先后而变化,即物光 a 是时间 t 的函数,记为:

$$a = a(x, t)$$

而参考光始终不变,故记为

$$r = r(x)$$

则总光场 $H(x, t)$ 为:

$$H(x, t) = r(x) + a(x, t) \quad (7)$$

因而在 Δt 时间内的曝光量可表示为

$$E(x) = |H(x, t)|^2 \Delta t$$

当考虑在 T 时间内连续曝光的时候,把时间 T 记为 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$, 同时分为 n 个小区间,第 i 个区间的长度为 Δt_i , 而在此时间内相应的曝光量为 $\Delta E_i(x)$, 则

$$\Delta E_i(x) = |H_i(x, t)|^2 \Delta t_i$$

因此,总的曝光量为 n 次曝光量之和,即

$$E(x) = \sum_{i=1}^n |H_i(x, t)|^2 \Delta t_i$$

根据定积分的定义,我们可以将记录介质在 x 点上的曝光量写成

$$E(x) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |H_i(x, t)|^2 dt \quad (8)$$

将方程(7)代入(8)式得,

$$\begin{aligned} E(x) &= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} (a_0^2 + r_0^2 + r^* a + r a^*) dt \\ &= E_r + E_s + r(x) \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} a^*(x, t) dt + r^*(x) \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} a(x, t) dt \end{aligned}$$

收稿日期:1978年7月27日。

我们知道与原像有关的项为最后一项, 并把这一项记为

$$E_P = r^*(x) \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} a(x, t) dt \quad (9)$$

利用矩形函数及傅里叶变换性质, 方程(9)可写成

$$E_P = Tr^*(x) \int_{-\infty}^{\infty} \text{sinc}(\pi\nu T) \tilde{a}(x, \nu) d\nu \quad (10)$$

其中

$$\sin cx = \frac{\sin x}{x}$$

$$\tilde{a}(x, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} a(x, t) e^{-2\pi i \nu t} dt$$

方程(10)可解释为, 它是一个线性滤波器, 具有转移函数 $\text{sinc}(\pi\nu T)$ 。

当我们考虑物体光束的位相变化对时间具有正弦型的依赖关系时, 则物光的一般表示式为:

$$a(x, t) = a_0(x, t) e^{i\varphi(x, t)}$$

$$\varphi(x, t) = \varphi_0 + K a (\cos \alpha + \cos \beta) \sin \omega t$$

其中 φ_0 为初位相, $K = \frac{2\pi}{\lambda}$, a 表示物体振动时的振幅, ω 为圆频率, 物体 $S(x_0, z_0)$ 运动方向为 V , 角 α 与 β 由图 3 所示。利用贝塞尔函数的二个展开式, 然后化简整理可得

$$E_P = Tr^* a_0 e^{i\varphi_0} J_0 [K a (\cos \alpha + \cos \beta)] \quad (11)$$

其中 $J_0(x)$ 表示零阶贝塞尔函数。

如果我们用与参考光波 r 全同的光波去

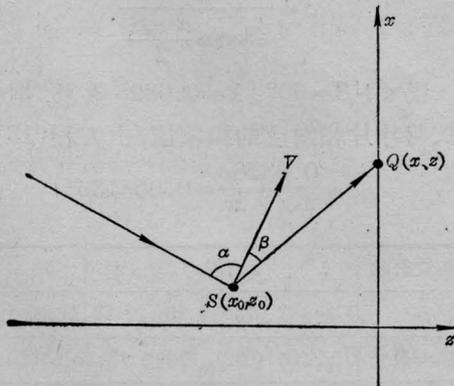


图 3

照明此全息图, 则与原像项对应的像, 即透射光波可表示为

$$W_P = Tr_0^2 a_0 e^{i\varphi_0} J_0 [K a (\cos \alpha + \cos \beta)] \quad (12)$$

由此得到 W_P 的光强为

$$\begin{aligned} I &= |W_P|^2 \\ &= T^2 r_0^4 a_0^2 J_0^2 [K a (\cos \alpha + \cos \beta)] \\ &= I_0 J_0^2(\rho) \end{aligned} \quad (13)$$

其中

$$I_0 = T^2 r_0^4 a_0^2 \quad (14)$$

$$\rho = \frac{2\pi}{\lambda} a (\cos \alpha + \cos \beta) \quad (15)$$

公式(13)称为时间平均法用于物体振动的基本方程, 它是分析研究被测物体的振态、应变、应力分布的理论根据。

二、基本方程的应用举例

下面是时间平均法用于叶片振动的例子, 被测物是压气机的叶片, 光路布置如图 4。为了计算的方便, 尽量使被测物体与记录介质平行, 物体振动方向垂直于叶片表面, 因此, 角 $\alpha = \beta$, 在此条件下, 制成全息图。图 5、图 6 为压气机叶片所拍摄的时间平均法照片。

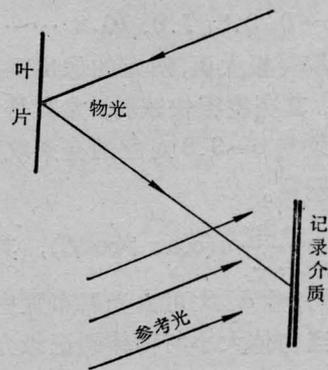


图 4

我们已知:

$$I = I_0 J_0^2(\rho)$$

由贝塞尔函数的性质知道, $J_0(\rho)$ 有无限多个极大点和极小点, 见图 7。



2370 赫芝

图 5



2030 赫芝

图 6

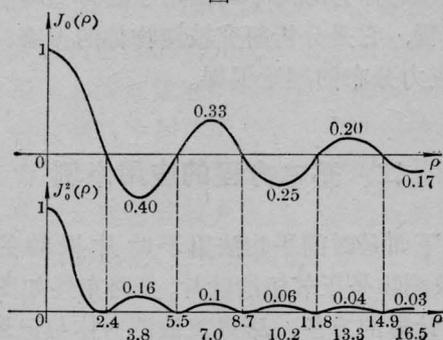


图 7

由图 7 可以见到, 当

$$\rho = 2.4, 5.5, 8.7, \dots$$

时, $J_0^2(\rho) = 0$, 因此, 对应的像在此处为暗条纹, 而当 $\rho = 0, 3.8, 7.0, 10.2, \dots$

时, $J_0^2(\rho)$ 取得极大值, 对应的像出现亮条纹, 可以看出, 其亮度很快减弱, 尤其是 $\rho = 0$ 对应的亮条纹与 $\rho = 3.8$ 对应的亮条纹, 其亮度相差更为明显。

由于 $\rho = \frac{2\pi}{\lambda} a(\cos \alpha + \cos \beta)$, 其中 λ 为波长(常数), 角 α, β 可由光路布置中实际测量所得, 当物体大小与物体到记录介质距离相比很小时, α, β 可以看作常量, 因此, 可以看出 ρ 值的大小唯一的由振幅 a 决定。

当 $a = 0$ 时, $\rho = 0$ 像上出现最亮的明条纹, 换句话说, 物体上与此明条纹相对应的部分振幅为零, 此最亮的线称为节线, 当远离节线时, 振幅 a 渐增, ρ 值也随之增大, 当

$\rho = 2.4$ 时, $J_0^2(\rho) = 0$, 像上出现一级暗条纹;

$\rho = 3.8$ 时, $J_0^2(\rho)$ 取极大值, 像上出现一级明条纹;

$\rho = 5.5$ 时, $J_0^2(\rho) = 0$, 像上出现二级暗条纹;

$\rho = 7.0$ 时, $J_0^2(\rho)$ 取极大值, 像上出现二级明条纹……。

由此看到: 时间平均法的像是以静止物体的像为背景, 再加上明暗相间的干涉条纹。

凡是全息像上最亮的条纹与物体上振幅为零的部位相对应, 称为节线。

节线两边的明暗条纹都是与物体上相同振幅的部位相对应的, 称为等幅线。

节线把物体分成若干个区域, 在同一区域内, 物体振动的位相是相同的, 而节线两侧振动的位相是相反的。

由于 $\rho = \frac{2\pi}{\lambda} a(\cos \alpha + \cos \beta)$, 解出 a 得

$$a = \frac{\rho \lambda}{2\pi(\cos \alpha + \cos \beta)} \quad (16)$$

事实上, 叶片振动方向很难精确判断, 因此, 角 α, β 无法测量, 故一般把方程(16)写成下面的形式

$$a = \frac{\rho \lambda}{4\pi \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}} \quad (17)$$

而 $\alpha + \beta$ 比较容易测定, 同时尽量使 $\alpha = \beta$, 于是

$$a = \frac{\lambda \rho}{4\pi \cos \frac{\alpha + \beta}{2}} \quad (18)$$

设 $\alpha + \beta = 60^\circ$, $\lambda = 0.6328$ 微米, 则像上条纹与叶片相对应的振幅值, 由方程(18)得

$$a = \frac{0.6328\rho}{2\sqrt{3}\pi} = 0.05813\rho \quad (19)$$

明条纹级数	1	2	3	4	5	6
ρ	3.848	7.015	10.20	13.32	16.47	19.62
振幅 a (微米)	0.2241	0.4078	0.5929	0.7743	0.9572	1.140

如果改变照相条件, $\alpha + \beta = 20^\circ$, 则

$$\alpha = \frac{0.6328\rho}{4\pi \cos 10^\circ} = 0.05111\rho \quad (20)$$

明条纹级数	1	2	3	4	5	6
ρ	3.848	7.015	10.20	13.32	16.47	19.62
a (微米)	0.1970	0.3585	0.5213	0.6808	0.8416	1.002

从上述二表可以看出,当 $\alpha+\beta$ 角度增大时,则等幅线将向远离节线方向移动,条纹间隔也相应加大,因此, $\alpha+\beta$ 测量值的误差直接影响振幅计算的精度。

从时间平均全息干涉的照片,能够比较精确地计算出振幅分布,根据材料力学的原理,在已知振动物体的振幅分布时,能够计算出振动物体的应力分布,因此,时间平均法干涉量度技术对振动物体的应力分析提供了新的途径。

以上例子,我们只计算到六级明条纹,为了能对更多级的条纹振幅进行计算,我们把 $J_0^2(\rho)$ 取极大及极小的 ρ 值列表于下。

$J_0^2(\rho)$ 各级极小值所对应的 ρ 值

n	ρ	n	ρ	n	ρ	n	ρ
1	2.404	9	27.49	17	52.62	25	77.74
2	5.520	10	30.63	18	55.76	26	80.89
3	8.653	11	33.76	19	58.90	27	84.03
4	11.79	12	36.91	20	62.04	28	87.18
5	14.93	13	40.05	21	65.18	29	90.32
6	18.07	14	43.19	22	68.33	30	93.46
7	21.21	15	46.34	23	71.47	31	96.60
8	24.35	16	49.48	24	74.61	32	99.74

$J_0^2(\rho)$ 各级极大值所对应的 ρ 值

n	ρ	n	ρ	n	ρ	n	ρ
1	3.848	9	29.05	17	54.19	25	79.32
2	7.015	10	32.19	18	57.33	26	82.46
3	10.20	11	35.33	19	60.47	27	85.60
4	13.32	12	38.47	20	63.61	28	88.75
5	16.47	13	41.62	21	66.75	29	91.89
6	19.62	14	44.76	22	69.90	30	95.03
7	22.76	15	47.90	23	73.04	31	98.17
8	25.90	16	51.04	24	76.18	32	

(上接第 16 页)

$$R_b = \frac{R_A}{n_A} + \frac{R_C}{n_C} \quad (18)$$

其中 R_A 、 R_C 、 n_A 、 n_C 分别为阴、阳离子的离子折射度和配位数。几种氧化物和氟化物在玻璃中的 \bar{n}_2 与 R_b 的关系见图7,氧化物和氟化物基本上在一条曲线上。在无机玻璃中氧离子和氟离子的配位数皆为2,氟离子的离子折射度($R_F=2.4$ 厘米³)比氧离子折射度($R_O=6.6$ 厘米³)小得多,所以氟化物在玻璃中的部分非线性折射率也比氧化物小得多。电价高的轻金属离子如 Be^{2+} 、 Mg^{2+} 、 B^{3+} 、 Al^{3+} 、 Si^{4+} 、 P^{5+} 等的离子折射度很小,所以这类氧化物和氟化物 \bar{n}_2 值也很小,应该选择这些化合物作为要求低 n_2 玻璃的主要成分。

参 考 文 献

[1] R. Hellwarch; Progress in Quantum Electronics, 1977, Vol. 5, Part 1.

[2] R. Hellwarch; Phys. Rev., 1975, B-11, No. 2, 964.
 [3] M. J. Weber; Appl. Phys. Lett., 1978, 32, No. 7, 403.
 [4] W. L. Smith; Phys. Rev., 1975, B-12, No. 2, 706.
 [5] M. D. Levenson; IEEE J., Quant. Electr., 1974, QE-10, No. 2, 110.
 [6] A. Qwyong; Phys. Rev., 1972, B-5, No. 2, 629.
 [7] A. Feldman; IEEE J., Quant. Electr., 1973, QE-9, No. 11, 1054.
 [8] M. J. Moran; IEEE J., Quant. Electr., 1975, QE-11, No. 6, 259.
 [9] E. S. Bliss, D. R. Speck, W. W. Simmons; Appl. Phys. Lett., 1974, 25, No. 12, 728.
 [10] D. Milam, M. Weber; Opt. Commun., 1976, 18, No. 1, 172.
 [11] LLL, 1974, Reports.
 [12] Schatt-Mainz Innovation, 1977.
 [13] 干福熹,《中国科学》, 1974, 7, No. 4, 351.
 [14] 干福熹,汪少胜,《中国科学院光学精密机械研究所集刊》,第六集,1964年,39页。
 [15] С. С. Багданов; Структурная рефрактометрия, 1959, стр. 32.